

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum
Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum
10. November 2005 (10.11.2005)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
WO 2005/106562 A1

(51) Internationale Patentklassifikation⁷: G02B 26/12, 7/182 (72) Erfinder; und
(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): BOCK, Gerhard [DE/DE]; Bergstr. 82, 82131 Gauting (DE).
SCHREPFER, Günter [DE/DE]; Rathausstr. 12, 82024 Taufkirchen (DE). WERNER, Marco [DE/DE]; Fronhöher Str. 13, 81475 München (DE).

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP2004/053312 (74) Gemeinsamer Vertreter: SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT; Postfach 22 16 34, 80506 München (DE).

(22) Internationales Anmeldedatum: 7. Dezember 2004 (07.12.2004) (81) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare nationale Schutzrechtsart): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM,

(25) Einreichungssprache: Deutsch (26) Veröffentlichungssprache: Deutsch

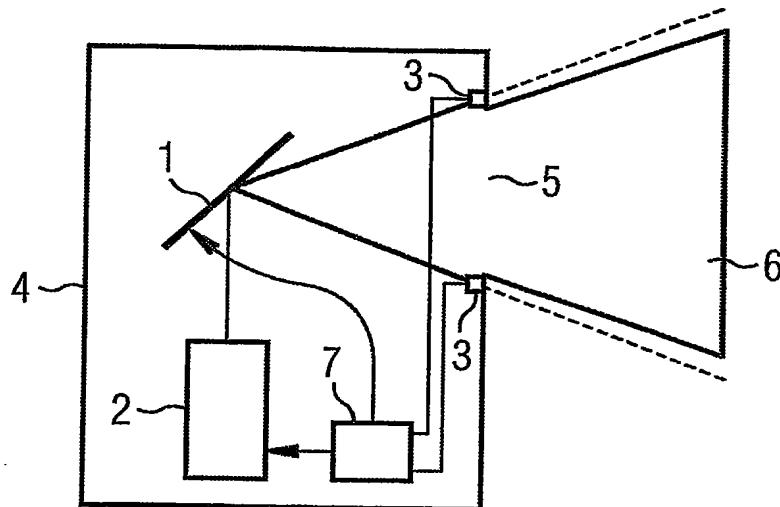
(30) Angaben zur Priorität: 04008022.8 1. April 2004 (01.04.2004) EP

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT [DE/DE]; Wittelsbacherplatz 2, 80333 München (DE).

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: DETERMINING THE EXCURSION OF MICROMIRRORS IN A PROJECTION SYSTEM

(54) Bezeichnung: BESTIMMUNG DER AUSLENKUNG VON MIKROSPIEGELEN IN EINEM PROJEKTIONSSYSTEM



(57) Abstract: The invention relates to a projection system comprising a light source (2), especially a laser light source, wherein a projection light beam (6) is generated by means of an oscillating mirror (1) starting from the light source (2). According to the invention, at least one light sensor (3) is provided in the marginal zone of the projection light beam (6) for detecting the position of the oscillating mirror (1).

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

WO 2005/106562 A1



TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

(84) Bestimmungsstaaten (*soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare regionale Schutzrechtsart*): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, MC, NL,

Veröffentlicht:

— mit internationalem Recherchenbericht

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Projektionssystem mit einer Lichtquelle (2), insbesondere mit einer Laser-Lichtquelle, bei dem ausgehend von der Lichtquelle (2) über einen Schwingspiegel (1) ein Projektions-Lichtbündel (6) erzeugt wird. Erfindungsgemäß ist zumindest ein im Randbereich des Projektions Lichtbündels (6) angeordneter Licht-Sensor (3) zur Erfassung der Position des Schwingspiegels (1) vorgesehen.